

미세구조분석실 사용료 안내

※ 예약 후 취소: 분석일 기준 3일전 미 취소 시 기본 사용료가 부과됩니다.

※ 시행일자: 2018. 07. 01.부

장비명	세부내역		분석료(원)	
			교내	교외
TEM 1(JEM3010, 300kV)	영상분석	기본사용료	100,000	160,000
		시간당		
투과전자현미경	EDS	Point(시료당)	30,000(시간당)	60,000(시간당)
	DATA	이미지당	미청구	미청구
TEM 2 (JEM2100F, 200kV) 전계방출 투과전자현미경	영상분석	기본사용료	140,000	210,000
		시간당		
	EDS(시료당)	point	40,000(시간당)	80,000(시간당)
		Line profile mapping		
	DATA	이미지당	미청구	미청구
		HAADF		
EELS	spectrum mapping	50,000(시간당)	100,000(시간당)	
TEM 3(ARM200F) 수차보정투과전자현미경	영상분석	기본사용료	200,000	300,000
		시간당		
	EDS(시료당)	point	60,000(시간당)	120,000(시간당)
		Line profile mapping		
	DATA	이미지당	미청구	미청구
		HAADF		
EELS	spectrum mapping	80,000(시간당)	160,000(시간당)	
※ Data 처리 시간은 분석 시간에 포함 (분석시간 1시간은 50분 기준)				

장비명	세부내역		분석료(원)	
			교내	교외
전처리	액체 질소	1회	2,000	4,000
	Epoxy Molding	시료당	10,000	20,000
	Epoxy Molding + Polishing	시료당	100,000	100,000
	Ion Beam Miller	10분당	4,000	8,000
	Jet Polisher	시료당	20,000	40,000
	Ultramicrotome	SEM(시료당)	100,000	100,000
		TEM(시료당)	300,000	300,000
	Cryo Ultramicrotome	SEM(시료당)	150,000	150,000
		TEM(시료당)	600,000	600,000
	Powder 전처리	시료당	5,000	5,000
	박막 전처리	시료당	300,000	300,000
	Grid(mesh)	개당	15,000	15,000
	Grid (holey carbon)	개당	25,000	25,000
	이온빔단면가공기 (Cross section polisher, CP)	Crosssection Polisher ※ Epoxy Molding 전처리 비용(시료당)		30,000
4시간 초과시 시간당 20,000원			60,000/2H	120,000/2H
			100,000/4H	200,000/4H

장비명	세부내역		분석료(원)	
			교내	교외
FIB (집속이온빔장치)	Etching, Deposition(시간)	FIB I, II	150,000	220,000
		FIB III	170,000	250,000
	Image(장)		2,000	3,000
	EDS	Point(시료)	34,000	50,000
		Line Profile(시료)	41,000	60,000
		Mapping(시료)	41,000	60,000
	TEM Sample Preparation (2시간 기준)	piece	340,000	500,000
		Cu grid	30,000	30,000
		Mo grid	50,000	50,000
	3D Tomo(시간)		204,000	300,000
	STEM(시료)		109,000	160,000
FE-SEM (전계방사주사전자현미경)	기본료		15,000	20,000
	영상분석	영상분석(시간)	60,000	80,000
		BSE분석(추가분석/시간)		
		Image(장)		1,500
	EDS	기본	20,000	30,000
		정량분석(시료)	15,000	20,000
		Mapping/Line Profile(시료)	15,000	20,000
	EBSD	기본	40,000	60,000
		2시간 초과시 시간당	30,000	40,000
		Data 분석(기본 PPT)	5,000	10,000
	Coating 일반	Coater(회)	15,000	20,000
	Coating PECS	C, W(회)	20,000	30,000
		Cr, Pt, Au-Pd(회)	30,000	40,000
	Nano indenter(나노경도측정기)	시간당		60,000